



0084

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)**

**Федеральное государственное унитарное предприятие
«Уральский научно-исследовательский институт метрологии»
(ФГУП «УНИИМ»)**

Государственный научный метрологический институт

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации методики (метода) измерений**

№ 253.0352/ 01.00258/ 2010

Методика измерений величины шероховатости поверхности методом
наименование методики (метода), включая наименование измеряемой величины
интерференционной оптической микроскопии (оптической профилометрии)
объекта и реализуемый способ измерений
предназначенная для измерения величины шероховатости поверхности
наноматериалов,
разработанная ГОУ ВПО «Уральский государственный университет
наименование и адрес организации (предприятия), разработавшей методику (метод)
им. А.М. Горького», 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.51,
содержащаяся в документе «Методика измерений величины шероховатости поверхности
обозначение и наименование документа, содержащего методику (метод) измерений,
методом интерференционной оптической микроскопии (оптической профилометрии)»
2010 г., число страниц 14

год утверждения, число страниц

Методика измерений аттестована в соответствии с ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений» и ГОСТ Р 8.563-2009.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке методики измерений и экспериментальным исследованиям

теоретические и (или) экспериментальные исследования

В результате аттестации методики измерений установлено, что методика измерений соответствует требованиям ГОСТ Р 8.563-2009

нормативно-правовой документ в области обеспечения единства измерений (при наличии) и ГОСТ Р 8.563

Показатели точности измерений приведены в приложении на 1 л.

Зам.директора по научной работе

С.В.Медведевских

Зав.лабораторией

Е.В. Осинцева

Дата выдачи:

13.12.2010

Рекомендуемый срок пересмотра
методики (метода) измерений:

5 лет

МН:



На 1 листе.

Лист 1 из 1.

Методика измерений «Методика измерений величины шероховатости поверхности методом интерференционной оптической микроскопии (оптической профилометрии)», используемая для измерения величины шероховатости поверхности наноматериалов, имеет показатели точности, представленные в таблице:

Т а б л и ц а - Показатели точности методики измерений

Измеряемая величина, нм	Диапазон измерений, нм	Показатели прецизионности, %	
		$\sigma_R^{отн}$	$\sigma_r^{отн}$
Ra	От 0,10 до 1,0 вкл.	20	10
Rq			
Rz			
Ra	От 1,0 до 10,0 вкл.	9	5
Rq			
Rz			
Ra	От 10 до 100 вкл.	5	3
Rq			
Rz			

и.о. Зав. лабораторией
ФГУП «УНИИМ»



Осинцева Е.В.

Дата выдачи: 13.12.2010

**Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Уральский государственный университет им. А.М. Горького»
(ГОУ ВПО УрГУ)**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по инновационной
работе ГОУ ВПО УрГУ


В.В. Кравцов
« 3 » 2010 г.



**Методика измерений величины шероховатости поверхности
методом интерференционной оптической микроскопии
(оптической профилометрии)**

МВИ 251.13.17.018-2009

Екатеринбург

2010